

Electron Beam Lithography System

ELS-ORCA

電子ビーム描画装置

R&D 向け電子ビーム描画装置の最新エントリーモデル



ELS-ORCA, 30 kV, 8 inch
シングルオートローダー

多様なオプションで最適な仕様にカスタマイズ

加速電圧 30 kV を標準とし、加速電圧 50 kV やダイナミックフォーカス・スティグマ、ハイトセンサーを用いたフォーカス調整等、様々なオプションをご用意しました。これらオプションを組み合わせることで、ご希望のパターンやご予算に合わせた装置仕様にカスタマイズ可能です。

ユーザーフレンドリーなソフトウェア

新たな装置制御ソフトウェア「elms (エルムス)」を標準搭載しました。CAD 変換やビーム調整、描画実行、SEM 観察など様々な機能を整理して分割することにより、必要な機能が見つけやすくなり、作業性が格段にアップしています。アカウント管理機能もあるため、ユーザーのレベルに合わせた機能制限等も可能です。

SEM観察に特化したリターディングオプション

低ダメージかつ高分解能な SEM 観察を可能とするリターディングオプションを選択可能です。SEM 装置相当の低加速電圧で、最大試料サイズ 8 inch、観察可能範囲 6 inch の SEM 観察を行えます。また、描画用 CAD を流用して座標を合わせた自動観察も可能です。

仕 様

電子銃	ZrO/W 熱電界放出型		最小ショットピッチ	0.1 nm	Software	elms (エルムス) ・ビーム調整機能 ・描画スケジュール機能 ・パターンデータ変換機能 ・アカウント管理機能 ・Python スクリプティング 
加速電圧	1 ~ 30 kV	1 ~ 50 kV*	最大フィールドサイズ	1000 μm □		
最小ビーム径	D 2.0 nm	D 1.6 nm	最大試料サイズ	8" ウェハー		
最小描画線幅	15 nm	10 nm	描画可能範囲	150 mm × 150 mm		
ビーム電流強度	5 pA ~ 80 nA		搬送機構	シングルオートローダー		
スキャンクロック	100 MHz					

* オプション

株式会社 エリオニクス

[本社・ショールーム] 〒192-0063 東京都八王子市元横山町3-7-6 営業本部 TEL.042-626-0611 FAX.042-626-6136
[ナノテクシステムセンター] 〒192-0012 東京都八王子市左入町279 顧客サポート課 TEL.042-692-0660 FAX.042-692-0690
[西日本営業所] 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-27 花原第2ビル 1F 101号 TEL.06-6711-4570 FAX.06-6711-4571